



EE55-1-VCR

Produktmerkmale

- Entnahmestelle für korrosive Gase und Gasgemische mit korrosiven Anteilen ab Qualität 6.0
- Montage-freundliches Design im Labor-Look
- Sehr hohe Regelgenauigkeit
- Druckregler mit angebundener Membrane
- Orbital-geschweißte VCR-Verbindungen
- Evakuierbar
- Manuelles Prozessgasventil (TPI)
- 100 % Helium-leckgeprüft
- Montage im Reinraum Klasse ISO 5.0

Technische Daten

Vordruck P_1 max. 50 bar

Hinterdruck P_2 max. 1,5 / 4 / 10 bar

Werkstoffe

Gehäuse: Edelstahl 1.4404

Membranen: Hastelloy C276

übrige gasberührte Teile: Edelstahl 1.4404

Dichtmaterialien

Druckregler: PTFE

Ventile: PCTFE oder PVDF

Oberflächengüte (gasberührte Flächen) $R_{a,max} \leq 0,25 \mu m$

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Leckraten

nach außen: $\leq 10^{-9}$ mbar l/s He

über den Ventilsitz: $\leq 10^{-6}$ mbar l/s He

c_v -Wert $c_v = 0,24$ ($k_v = 0,2$)

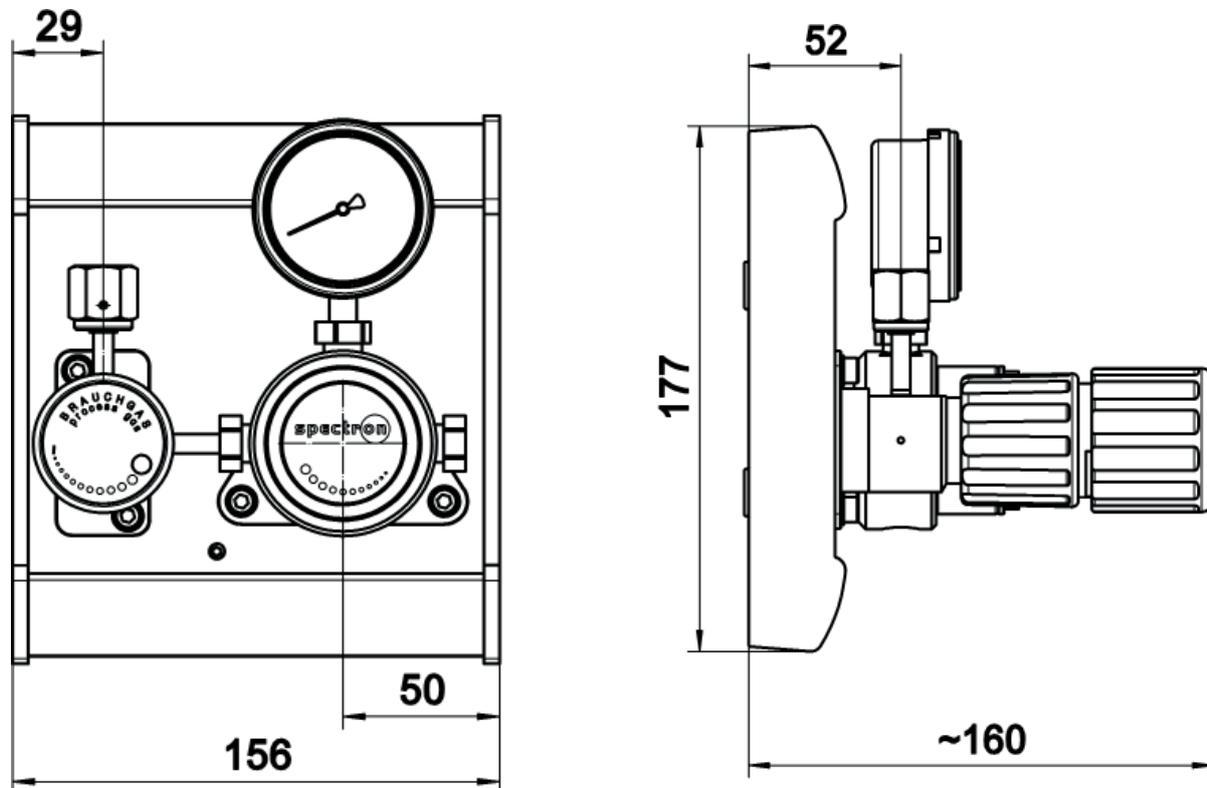
Gewicht 3,0 kg

Anschlüsse

Eingang: VCR-Überwurfmutter

Ausgang: VCR innen

Hauptabmessungen



Bestellangaben: Entnahmestelle EE55-1-VCR

EE55-1-VCR - 10 - Gas

Hinterdruckbereich P_2

1,5	max. 1,5 bar
4	max. 4 bar
10	max. 10 bar

Gasart

Bitte Gasart zur Auswahl der Dichtwerkstoffe angeben